原研TIARA施設の概要

中村義輝、福田光宏、高田 功、神谷富裕、田島 訓、荒川和夫、西堂雅博、小原祥裕 日本原子力研究所 高崎研究所 放射線高度利用センター 〒370-1292 群馬県高崎市綿貫町 1233

概要

原研 TIARA(Takasaki Ion Accelerators for Advanced Radiation Application)は、イオンビーム利用の拠点研究施 設として平成5年7月に完成して以来、主として材料科学 やバイオ技術研究などの先端研究分野に多種多様なイオ ン種を提供してきた。TIARA 施設の加速器は、これまで 約10年間に渡り順調な運転を継続しており、研究成果の 創出に貢献してきている。ここでは、TIARA 施設の概要 とそれぞれの加速器の特徴等、さらには代表的な加速器技 術の開発や装置整備等についても記述する。

1 TIARA 施設の概要

TIARA 施設は、930型 AVF サイクロトロン[1],[2]及び3 台の静電加速器[3],[4] (タンデム加速器、シングルエンド 加速器及びイオン注入器)から成る複合型加速器施設であ る。これら4基の加速器から提供されるイオン種の加速エ ネルギー範囲を図1に示す。利用可能なイオン種は、質量 数1の陽子から質量数 200 程度の金やビスマスイオンま



での広範囲に渡ってお り、それらの加速エネル ギーは 20 keV~970 MeV と約5桁にも及ん でいる。また、これらの 加速器装置では、スキャ ン(拡大照射)ビーム、 パルスビーム、カクテル ビーム、大気取り出しビ ーム、デュアル・トリプ ルビームなどの複合ビ -ム、um サイズの軽・ 重イオンマイクロビー ム、クラスタービーム、 等々の多様なビーム利 用の形態が可能となっ ている。

図1:利用可能イオン種の質量 数とエネルギーとの相関図。

2 AVF サイクロトロン装置

サイクロトロン装置全体の構成図を図2に示す。イオン 源は ECR 型が2台と、軽イオン用の Multi-cusp1台があり、 外部入射方式となっている。入射系にはビーム制御機器と して、SUS の多孔薄板で作られているアッテネーター(ビ ーム減衰率は最大で10¹⁰程度)、パルス型のチョッパー、 2種類(正弦波型及び鋸歯状波型)のバンチャー等が設置 されている。

原研 AVF サイクロトロンは、住友重機械製の 930 型(K 値 110) であり、SF 型の常電導サイクロトロンとしては世 界で最大級のものである。サイクロトロンは、セクター数 が4、ディー電極数が2、加速ハーモニック数1,2及び 3が可能で、RF 共振器には同軸型が採用されている。

ビーム輸送系は、水平ビームライン8本、垂直ビームラ



図2:サイクロトロン装置の全体構成。

イン4本から構成されており、合計16ヶ所のターゲット ポートが準備されている。同様に輸送系には、正弦波型チ ョッパー、3台の磁場偏向型スキャナー等が配置されてお り、利用者の実験利用を支援している。

サイクロトロン装置整備における代表的な事項を以下 に示す。1999年3月には、HYPERNANOGAN(HECR)が導 入され、このためのイオン入射系も付加設置された。設置 直後における HECR の外観を図3に示す。HECR は主とし て金属イオンの生成を目的としており、これまで Ca, Fe, Ni, Ru 及び Au イオンなどの開発を行ってきている。

また同時期に、制御機能の高度化や容量の増大などが必要となり、さらに構成機器の交換部品等の入手が困難になってきたこと、などの理由ら計算機システム及び制御プログラムを全面的に更新した。図4には更新された制御系の概要を示す。MTC以下の階層構成部分は変更せず、Computer等の上部階層は全て更新された。

これまでに発生した種々の故障等については、1) 1993/12:プラー電極の支持用アルミニウムブラケットの 変形・損傷、2)1994/06:TMP(600 L/s)が破損し、ポン プの回転翼等がビームラインダクトの広範囲に飛散、3) 1996/09:ハーモニック切換作業中に、インフレクタース テム(約350 kg)が約1.7 m落下、4)1998/03:マグネテ ィックチャンネル入口バッフル部から加速箱内に大量(約 50 L)の漏水、6)2000/09:ECR イオン源の OCTOPUS

本及スの水が例 術てを 内後一部入的の次開も以 で次開、下 部方シに、的。置つ数す に要示 ないの数す。



図3: HYPERNANOGAN の外観。



図4:更新したサイクロトロン装置制御系の概要。

宇宙用半導体材料の耐放射線性試験などでは、LET 依存 性等の実験が行われる事が多く、イオン種を変更するよう な一連のデータ取得には数ヶ月を要していた。このため、 Cocktail beam 開発が進められ、1996 年には M/Q=5 のシリ ーズ ($^{15}N^{3+}$, $^{20}Ne^{4+}$, $^{40}Ar^{8+}$ 及び $^{84}Kr^{17+}$) が最初に実用化さ れた。その結果、イオン種の切換が数分で可能となり、実 験効率の飛躍的な改善が計られた。また、現在では M/Q=4及び M/Q=2 のシリーズも追加開発されている。

これまで多くのサイクロトロンでは、運転条件に依って はビーム強度が時間とともに減少し、時々補正磁場を調整 するのが通例であった。このビーム減少の原因は、本体電 磁石部分の温度変動に起因する磁場変動であることが初 めて見出された。1999 年度には、電磁石の温度安定化を 目的として、メインコイル用の断熱ジャケット(図5参照) を設置するとともに、分離したトリムコイルの冷却水系統 に、独立の高精度温度制御を導入した。その結果、ビーム 電流は数10h後においても約10%程度の減少に抑制され、 電流安定度の大幅な改善が実現された[5]。



図5:断熱ジャケットの一部(設置前)

度化を目的とした中心領域の改造、鋸歯状波型バンチャー の設置等々が実施され、現在ビームテストが進行している。

3 静電加速器

静電加速器群で、最も高いエネルギー範囲を受け持つの が3 MV のタンデム加速器であり、米国の NEC 製である。 また、3 MV のシングルエンド加速器及び 400 kV のイオン 注入装置は、それぞれ日新ハイボルテージ製及び日新電機 製である。これら3台の静電加速器は、ビームの複合利用 を主眼にして選定されたものであり、得られるビームエネ ルギーは、おおよそ20 keV~20 MeV の範囲となっている。

3 MV タンデム加速器は、3 台の負イオン源を備え、得られる最大エネルギーは、H で 6 MeV、He で 9 MeV、その他の重イオンでは 18 MeV 程度である。昇電圧にはペレットチェーンを用いており、加速電圧は 0.4~3.0 MV で連続可変となっている。加速器本体は、0.5 MPa の SF₆が充

填されている横型円筒形圧力タンク中に収納されており、 その中央部には荷電変換のためのガスストリッパーが設 置されている。また3MVシングルエンド加速器は、サブ ミクロン径のマイクロビーム形成を実現するため、10ppm の高い電圧安定度を備えた軽イオン専用の加速器であり、 電圧の極性変換により電子の加速も可能となっている。昇 電圧には対称型のシェンケル回路を採用しており、RFイ オン源、加速部、昇圧部等は全て0.6 MPa 程度の SF₆を満 たした圧カタンク内に設置されている。400 kV のイオン 注入装置は、フリーマン型イオン源を搭載しており、軽イ オンから重イオンまでの広範なイオンを、最大 400 keV ま で加速できる。

次に3台の静電加速器及びそれらのビームライン及び ターゲットポート等の配置を図6に示す。ビームラインは、 それぞれの加速器単独のビームラインと、デュアル(MD1 と MD2 ポート)及びトリプル(MT1)の複合ビームライ ンから構成されている。また、第1ターゲット室のTB ラ インには、重イオンマイクロビーム装置が、一方第3ター ゲット室のSB ラインには、軽イオンマイクロビーム装置 がそれぞれ設置されている。



図6:静電加速器及びビームライン配置。

加速器の整備では、ほぼ1万時間運転を目途として加速 管の交換(3台について、1997年度及び1998年度)、イ オン注入装置の絶縁碍子更新(2000年度)を行った。ま た 2000年度には、グラフィックターミナルの故障の頻発 や修理の困難さが深刻になってきていたこと、制御系中枢 のボードコンピューター部分のサポート体制に懸念が生 じてきたこと、などの理由からタンデム加速器の制御系を 更新した。更新した制御系の概要を図7に示す。更新にあ たっては、できるだけ汎用品で制御システムを構築し、長 期間での維持・管理を可能にするよう配慮した。

またこれまでに発生した主な故障等については、1) 1994/08:タンデム加速器、ペレトロンチェーン用のプー リー軸に異常摩耗が発生、2)1997/02:シングルエンド 加速器、リップル調整器の電流導入端子部分が異常過熱 3)1995/11:イオン注入装置、高電圧デッキに電力を供 給する絶縁碍子が損傷、等々が挙げられる。

さらに代表的な装置・技術開発等の内容を以下に示す。 マイクロビーム形成技術の開発では、前述のように重イオ ンマイクロビーム装置をタンデム加速器のビームライン



図7:更新されたタンデム加速器制御系の概要

に設置した。ビーム光学系の計算や電磁石磁場解析の結果 に基づいて、マイクロスリット、発散制限スリット及び精 密Qレンズの最適設計を行った。その結果、1 µm 径のマ イクロビームを形成するとともに、ビーム照準技術との組 み合わせにより、任意の位置へのシングルイオンヒット加 工技術も開発した。また、この重イオンマイクロビーム形 成技術の展開により、シングルエンド加速器に軽イオンマ イクロビーム装置を設計・設置し、最小ビーム径 0.25 µm のマイクロビームを達成した[6]。

タンデム加速器で、イオン源及びガスストリッパーの 運転条件等を最適化することにより、C, Si, Ag, Au など6 種類の実用強度のクラスターイオンを開発した[7]。フリ ーマンイオン源のサポートガスに SF6を使用して、B, Si, Nb, Mo, Ta 等の高融点金属イオンを、高強度で安定に生成 する技術を開発した。また、シングルエンド加速器で加速 されたプロトンビームを対象に、²⁷Al(p,γ)²⁸Si あるいは ²⁴Mg(p,γ)²⁵Al の共鳴核反応を利用して、ビームエネルギー 値及びエネルギー幅を正確に測定する方法を開発した。

4 加速器の運転・利用状況

TIARA 施設の実験利用は、年間を3期に分割した形態 となっており、実験課題の申請からヒアリング審査・評価 等を経て、各実験者に利用時間を割り当てる方式となって いる。また利用運転については、サイクロトロン装置は、 月曜日朝から金曜日夕方までの週単位の昼夜連続運転が 基本となっている。一方静電加速器は、Daily operation が 基本であり、08:30~20:00 までのAモード、及び23:00 ま でのBモード運転の2種類での対応となっている。

サイクロトロン装置の運転時間は、最近 10 年間では全 て 3000 h 以上を堅持しており、平均年間時間は 3216 h と なっている。また、加速器の利用が年々多様化しているこ とから、運転条件の変更頻度が増大しており、これらの状 況を図8に示す。加速モード、イオン種、エネルギー及び ビームコースの切換頻度は、いずれも年々増加の傾向を示 しており、特にビームコースの切換回数は年間で約 290 回以上にも達している。これらの状況は、サイクロトロン 装置の実験利用が細分化されていることを示唆するもの であるが、反面この事実はいわゆる装置の利用効率が徐々 に低下していることを意味しており、将来的な施設運用に おける懸案事項の一つともなっている。

一方静電加速器3台の年度別運転時間を図9に示す。



図8:過去11年間における加速モード、イオン種、エネ ルギー及びビームコースの切換頻度の推移。

1996年度に運転員の増員が行われたことから、23時までの時間外運転が実施され、この時期から運転時間の拡大が計られた。過去6年間における平均年間運転時間は、タンデム加速器、シングルエンド加速器及びイオン注入装置で、それぞれ1986h、2376h及び1830hとなっている。また、デュアル及びトリプルビームの複合照射の割合は、各加速器とも約20%となっているが、徐々にトリプルビーム利用が増加する傾向にある。さらに最近では、大気マイクロPIXE分析技術の開発や各種試料の分析実験等で、軽イオンマイクロビームの利用頻度が増大している。



図9:静電加速器3台の年度別運転時間。

参考文献

[1] Y. Nakamura, T. Nara, T. Agematsu, I. Ishibori, *et al.*, JAERI-Review 2002-035 (TIARA Annual Report 2001) pp. 300-302 (2002)

[2] 中村 義輝、奈良 孝幸、上松 敬、石堀 郁夫、他:第 12 回 TIARA 研究発表会予稿集、pp33-34 (2003)

[3] 田島 訓、高田 功、水橋 清、宇野 定則、他: JAERI-Tech 96-029, 137p (1996)

[4] 高田 功、水橋 清、宇野 定則、大越 清紀、他:第 12 回 TIARA 研究発表会予稿集、pp35-36 (2003)

[5] S. Okumura, S. Kurashima, T. Ishimoto, W. Yokota, *et al.*, Proc. 13th Sympo. Accel. Sci. Technol., Suita, Osaka, Japan, pp. 283-285 (2001)

[6] T. Kamiya, T. Suda and R. Tanaka, Nucl. Instr. and Meth., **B118**, pp. 447-450 (1996)

[7] Y. Saitoh, K. Mizuhashi and S. Tajima, JAERI-Review 99-025 (TIARA Annual Report 1998), pp. 264-265 (1999)